

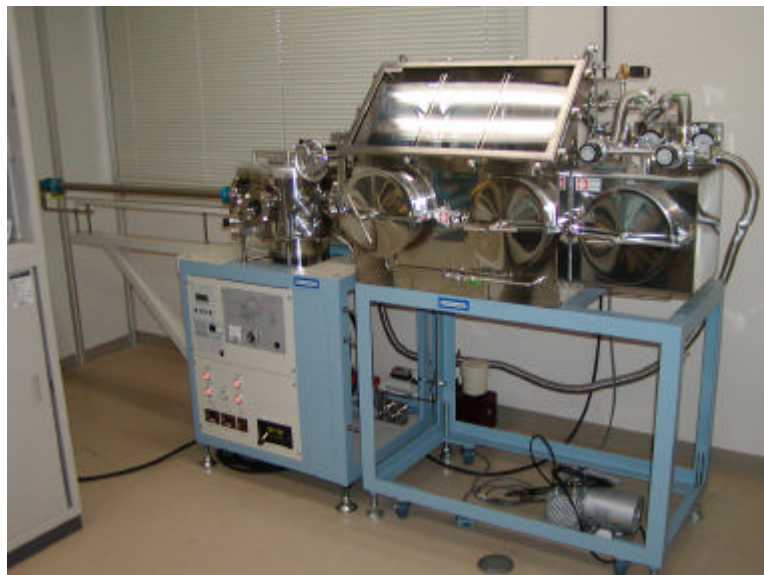
主要仕様

型名 E - 50 シリーズ



Vacuum is our business

本装置の特徴と主要仕様



本装置は当社の今までに蓄積された研究装置の設計コンセプトを複合して完成させた真空対応のグローブボックス付の研究用蒸着装置で以下に示すような多くの特徴を備えています。

- 1、標準装置構成はターボ分子ポンプを主排気ポンプとした蒸着室に真空対応のグローブボックスを結合させた蒸着装置です。グローブボックス内にて前処理等をされた基板を大気にさらすことなく蒸着室に移動できます。
- 2、蒸発源はチャンバー底面フランジに取りつける構造としており装置をお納めした後もセル源の取り付けなどに容易に変更可能な構造です。ご研究内容の変化により柔軟に対応が可能です。
- 3、チャンバーは研究に適した多くのフランジを設けております。チャンバー周囲にはIF規格サービスフランジを備えていますので多くの市販の真空部品の取り付けが可能です。
- 4、主排気系には信頼性の高いファイファーバキューム(ドイツ製)ターボ分子ポンプを備えていますのでクリーンな真空が得られます。

株式会社ALSテクノロジー

東京都三鷹市下連雀 3-38-4 〒181-0013 三鷹産業プラザ内

Phone 0422-70-0581 Fax 0422-70-0582

E-mail als-sales@mugen.ne.jp URL <http://www.megen.ne.jp/als/>



仕様項目	仕様
チャンバーサイズ	ステンレス製、円筒型（上部ハッチ式の蓋はアルミ製） 直径 約 250*高さ250 蒸着源と基板の距離は約200mm ビューイングポート1式 グローブボックス接続用ポート2式（ゲートバルブ1式付属） サービスポート ICF 70規格（2個）付属
排気系	主排気ポンプ ターボ分子ポンプ ファイファー 60L/SEC 荒引きポンプ 1式 到達真空度 10-6torr 台（無負荷の場合）
内部機構	基板ホルダー ・基板搬送軸に固定して蒸着 基板の受け渡し機構は付属しません。（受け渡し機構はオプション設定） 基板サイズ ホルダーサイズ 最大 50mm角 シャッター 基板ホルダー側 1基
蒸着源	抵抗加熱蒸着源対応（有効ポート長 約40mm。本体には付属しません。） 蒸発源の数 2源 同時蒸着 ありません。（同時蒸着機構はオプション設定） 蒸着電源 130Ax6V 1式標準搭載
グローブボックス	真空対応（精製機構はありませんので高純度ガスを導入してください。） グローブボックス室の寸法 幅650×高さ600×奥行550 予備室付（真空対応） 真空ポンプ ロータリーポンプ 本体用と兼用 練成圧力計（ブルドン管型）2個搭載
蒸着モニター	インフィコン社製 水晶式モニター XTM/2 1式 （検出器1式、OSCパッケージ1式付き）
搬送系	磁気結合型の直線導入機 グローブボックスとの間はゲートバルブ仕切り弁付き
操作 真空計	排気操作 手動 、 蒸着操作 手動 ファイファーバキューム製真空計（フレレンジゲージPKR-251）
入力電源、 他の用力	AC100V 20A 1系統 冷却水（膜厚計冷却用） 若干 N2ガス（パージ用）

備考 上記仕様は標準的仕様について記載したものです。詳細仕様はお見積もり仕様書にて御確認ください。
チャンバー寸法他、各ユニットについては予告なしに仕様変更する場合があります。